

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第2部門第3区分
 【発行日】令和3年8月12日(2021.8.12)

【公開番号】特開2021-91090(P2021-91090A)
 【公開日】令和3年6月17日(2021.6.17)
 【年通号数】公開・登録公報2021-027
 【出願番号】特願2021-25129(P2021-25129)
 【国際特許分類】

B 2 4 B 37/013 (2012.01)
B 2 4 B 49/16 (2006.01)
B 2 4 B 49/10 (2006.01)
B 2 4 B 49/12 (2006.01)
B 2 4 B 37/30 (2012.01)
B 2 4 B 55/06 (2006.01)
B 2 4 B 41/06 (2012.01)
H 0 1 L 21/677 (2006.01)
H 0 1 L 21/304 (2006.01)

【F I】

B 2 4 B 37/013
 B 2 4 B 49/16
 B 2 4 B 49/10
 B 2 4 B 49/12
 B 2 4 B 37/30 Z
 B 2 4 B 55/06
 B 2 4 B 41/06 A
 H 0 1 L 21/68 A
 H 0 1 L 21/304 6 2 2 S
 H 0 1 L 21/304 6 2 2 Q
 H 0 1 L 21/304 6 2 2 G
 H 0 1 L 21/304 6 2 2 L

【手続補正書】
 【提出日】令和3年7月1日(2021.7.1)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項1】

基板を研磨するとともに研磨に関する信号を取得する基板処理装置と、中間処理装置と、データ処理装置とを有し、前記基板処理装置と前記中間処理装置は第1の通信手段により接続され、前記中間処理装置と前記データ処理装置は第2の通信手段により接続される研磨装置を制御するためのコンピュータに、

前記中間処理装置に対して、前記基板処理装置が取得した前記信号に基づいて、研磨処理に関するデータを作成させるステップと、

前記データ処理装置に対して、前記データに基づいて前記基板処理装置の研磨処理の状態を監視させるステップと、を実行させるためのプログラム。

【請求項2】

前記データは、複数の前記データを有するデータセットであることを特徴とする請求項 1 記載のプログラム。

【請求項 3】

前記プログラムは、前記データ処理装置に対して、前記基板処理装置が取得した前記信号に基づいて、前記研磨処理に関するパラメータを更新させるステップを有することを特徴とする請求項 1 または 2 記載のプログラム。

【請求項 4】

前記プログラムは、前記基板処理装置に対して、前記データ処理装置からのデータが、終点が検知されたことを示すデータの場合、終点が検知されたと判断して、研磨を終了させるステップを有することを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれか 1 項に記載のプログラム。

【請求項 5】

前記プログラムは、前記研磨装置の制御部に対して、前記基板処理装置の監視と制御を行わせて前記基板処理装置を運転させるステップを有することを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載のプログラム。

【請求項 6】

前記プログラムは、前記研磨装置の制御部に対して、前記基板処理装置の異常および / または寿命の予測および / または判断および / または表示を行わせるステップを有することを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載のプログラム。

【請求項 7】

前記プログラムは、前記中間処理装置および / または前記データ処理装置に終点検出の判定を自動学習させ、および / または研磨パラメータの更新を自動学習させるステップを有することを特徴とする請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 項に記載のプログラム。

【請求項 8】

前記基板処理装置は、前記基板を保持するための保持部を有し、前記保持部はカルーセルまたはトラックに配置される、ことを特徴とする請求項 1 ないし 7 のいずれか 1 項に記載のプログラム。